

明細書

液晶流動形成機構、液晶流動形成方法および液晶流動を用いた物体移動機構

5 技術分野

本発明は、液晶流動を用いた物体移動機構、液晶流動形成機構および液晶流動形成方法に関する。液晶とは、流動性はあるが、光学的には異方性で、複屈折を示し、結晶のような性質をもつ状態又はそのような状態を示す物質をいう。この液晶に対して電界や磁界を加えると、全ての液晶分子は、その重心回りに同じ方向に回転し、その軸方向が電界や磁界の方向に対して液晶固有の角度に配向する。本発明は、かかる液晶の性質を利用した液晶流動を用いた物体移動機構、液晶流動形成機構および液晶流動形成方法に関する。

背景技術

従来から液晶は、液晶分子が配向することによってその光学的性質が変化するため、この性質を利用して液晶ディスプレイ等の情報表示装置に使用されている。

また、液晶は、電界や磁界を加えて液晶分子の配向方向を変化させると液晶自体の粘性が変化する、つまり電気粘性流体としての性質も有している。このため、電気粘性流体としての性質を利用した軸受やダンパー等が開発されている。

一方、液晶分子が配向するときに、液晶流動が発生することが知られている。例えば、図9に示すように、一对の固定平行板P、P間に液晶を入れて、その液晶分子mを、その軸方向が一对の固定平行板P、Pと平行になるように配列する。そして、この液晶に、一对の固定平行板P、Pと垂直な電界を加えれば、液晶分子mが回転し、この液晶分子mの回転に起因する液晶流動が発生する。つまり、液晶を用いることによって、電気エネルギーを運動エネルギーに変換することができるのである。

しかし、この液晶分子mの運動エネルギー、つまり液晶流動を工業的に利用することを考えた者は未だおらず、当然のごとくこの液晶流動を積極的に利用する方法や装置は存在していない。

本発明はかかる事情に鑑み、工業的に利用可能な液晶流動を形成することができる液晶流動形成機構および液晶流動形成方法、および液晶流動を利用した物体移動機構

を提供することを目的とする。

発明の開示

第1発明の液晶流動形成機構は、流路と、該流路の壁面に沿って移動可能に設けられた液晶と、該液晶の液晶分子を、前記流路の壁面と交わる面内で回転させる液晶分子回転手段とからなり、前記液晶の液晶分子が回転したときに発生する液晶流動を利用することを特徴とする。

第2発明の液晶流動形成機構は、第1発明において、前記液晶が、前記流路の壁面と交差する軸周りにツイストされたことを特徴とする。

第3発明の液晶流動形成機構は、第1発明において、前記流路が、対向する一对の壁面を有しており、該流路の一对の壁面間に、前記液晶が入れられており、前記流路の一对の壁面間において、前記液晶がツイストされていることを特徴とする。

第4発明の液晶流動形成機構は、第1、2または3発明において、前記液晶分子が、前記流路の壁面に対してチルトしていることを特徴とする。

第5発明の液晶流動形成機構は、第1、2、3または4発明において、前記液晶分子回転手段が、前記液晶に、電界または磁界を加えるための配向装置を備えたことを特徴とする。

第6発明の液晶流動形成機構は、第1、2、3、4または5発明において、前記液晶分子回転手段が、前記液晶に電界または磁界を加えるタイミングを制御する制御装置を備えており、該制御装置が、前記液晶に電界または磁界を断続的に加えることを特徴とする。

第7発明の物体移動機構は、互いに対向する壁面を有し、前記壁面を対向させた状態で、相対的に移動可能な一对の部材と、該一对の部材の対向する壁面間に、該対向する壁面に沿って移動可能に入れられた液晶と、前記液晶の液晶分子を、前記一对の部材の対向する壁面のうち、一方の壁面と交わる面内で回転させる液晶分子回転手段とからなることを特徴とする。

第8発明の物体移動機構は、中空な空間を有する外側部材と、該外側部材の中空な空間の内部に、前記外側部材に対して回転自在に配設された内側軸と、前記外側部材の内面と、前記内側軸の外面との間に入れられた液晶と、前記液晶の液晶分子を、前

記内側軸の外表面または前記外側部材の内面のいずれか一方と交わる面内で回転させる液晶分子回転手段とからなることを特徴とする。

第9発明の物体移動機構は、中空な空間を有する外側部材と、該外側部材の中空な空間の内部に収容され、前記外側部材の中空な空間を分割する内側部材と、前記外側部材の中空な空間に入れられ、前記外側部材の内面と交差する軸周りにツイストされた液晶と、前記液晶の液晶分子を、前記外側部材の内面と交わる面内で回転させる液晶分子回転手段とからなり、前記内側部材が、前記外側部材の内面に沿って移動可能であり、前記液晶の液晶分子における、前記内側部材から遠い側の端部が、前記外側部材の内面に対してチルトしていることを特徴とする。

第10発明の物体移動機構は、第7、8または9発明において、前記液晶分子回転手段が、前記液晶に、電界または磁界を加えるための配向装置を備えたことを特徴とする。

第11発明の物体移動機構は、第7、8、9または10発明において、前記液晶分子回転手段が、前記液晶に電界または磁界を加えるタイミングを制御する制御装置を備えており、該制御装置が、前記液晶に電界または磁界を断続的に加えることを特徴とする。

第12発明の液晶流動形成方法は、液晶を、流路内に、その壁面と交差する軸周りにツイストして配置し、液晶分子回転手段によって、前記液晶の液晶分子を、前記流路の壁面と交わる面内で回転させることを特徴とする液晶流動形成方法。

第13発明の液晶流動形成方法は、第12発明において、前記液晶分子回転手段が、前記液晶に電界または磁界を加えるタイミングおよび前記液晶に加える電界または磁界の大きさを制御する制御装置を備えており、該制御装置によって、前記液晶に電界または磁界を断続的に加えることを特徴とする。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の液晶流動形成機構の概略説明図であり、(A)はYZ断面図であり、(B)はYZ断面図において電界を加えたときにおける液晶分子の配列を示した図であり、(C)はYZ断面図において電界を加えたときに一对の壁面B間に

発生する液晶の速度分布を示した図である。

図2は、本発明の液晶流動形成機構の概略説明図であり、(A)はX Y断面図であり、(B)はX Y断面図において電界を加えたときにおける液晶分子の配列を示した図であり、(C)はX Y断面図において電界を加えたときに一对の壁面B間に発生する液晶の速度分布を示した図である。

図3は、電界が加えられたときにおける液晶分子mの動きの説明図である。

図4は、平行板P上に載せられた液晶LCに電界が加えられたときにおける液晶分子mの動きの説明図である。

図5は、第一実施形態の物体移動機構の説明図である。

10 図6は、第二実施形態の物体移動機構の説明図である。

図7は、第三実施形態の物体移動機構の説明図である。

図8は、(A)は液晶のツイスト角に対するZ軸方向の流量を示した図であり、(B)は液晶のツイスト角に対するX軸方向の流量を示した図であり、(C)は流動方向のZ軸の正の部分に対する角度を、液晶のツイスト角に対して示した図である。

15 図9は、電界が加えられたときにおける液晶分子mの動きの説明図である。

発明を実施するための最良の形態

まず、本発明の液晶流動形成機構を説明する前に、液晶に電界や磁界を加えたときに、液晶流動が発生する原理を説明する。

20 なお、液晶は、電界や磁界を加えたときに、電界や磁界の方向に対して液晶分子の軸方向が液晶固有の角度に配向するが、以下には、電界や磁界を加えたときに、液晶分子の軸方向が電界や磁界の方向と平行になるような液晶について説明する。

また、液晶分子は、電界、磁界いずれを加えた場合でも配向するので、以下には電界を加える場合のみを説明する。

図3は電界が加えられたときにおける液晶分子mの動きの説明図である。図4は平行板P上に載せられた液晶LCに電界が加えられたときにおける液晶分子mの動きの説明図である。図3に示すように、液晶LCに、その液晶分子mの軸方向と交差するように電界efを加えると、液晶分子mは、その回転角度が小さく

なる方向（図 3 (A) では矢印の方向）に、その軸方向が電界 $e f$ と一致するまで回転する（図 3 (B) ）。すると、各液晶分子 m の周囲には速度勾配が発生するので、液晶流動が発生するのである（図 3 (C) ）。

図 4 (A) において、符号 F は平行板 P 上に設けられた配向膜を示している。この配向膜 F の素材は、例えばポリイミド等の高分子物質である。この平行板 P の配向膜 F に液晶 $L C$ の一部を接触させると、平行板 P 近傍の液晶分子 m は平行板 P の配向膜 F に拘束（以下、アンカリングという）される。すると、電界 $e f$ を加えても、平行板 P の近傍に位置する液晶分子 m は、その軸方向が電界 $e f$ と一致するまで回転することができず、回転量が小さくなる（図 4 (B) ）。しかも、液晶分子 m の回転量は、平行板 P に近づくほど小さくなり、平行板 P 上では 0 となるので、液晶分子 m の回転によって、その周囲に形成される速度勾配も、平行板 P に近づくほど小さくなる（図 4 (C) ）。

したがって、液晶 $L C$ において、その一部の液晶分子 m の動きを平行板 P の配向膜 F によってアンカリングすれば、液晶 $L C$ 内に、図 4 (D) に示すような速度分布を有する液晶分子 m の流れが発生するのである。

さて、本発明の液晶流動形成機構を説明する。

図 1 は本発明の液晶流動形成機構の概略説明図であり、(A) は $Y Z$ 断面図であり、(B) は $Y Z$ 断面図において電界を加えたときにおける液晶分子の配列を示した図であり、(C) は $Y Z$ 断面図において電界を加えたときに一对の壁面 B 間に発生する液晶の速度分布を示した図である。

図 1 において、符号 L は、後述する液晶 $L C$ が流動する流路を示している。この流路 L は、対向する一对の壁面 B 、 B を備えている。この一对の壁面 B 、 B は、互いに平行かつ、いずれの壁面 B も平坦面に形成されている。

なお、対向する一对の壁面 B 、 B は平行でなくてもよく、一方の壁面 B に対して他方の壁面 B が傾斜していてもよい。

さらになお、各壁面 B は平坦面でなくてもよい。例えば一方の壁面 B が平坦面であって他方の壁面 B が凹凸を有する面でもよいし、いずれの壁面 B も凹凸を有する面であってもよい。

前記流路 L の一对の壁面 B 、 B 間には、液晶 $L C$ が入れられている。この液晶 $L C$

は、例えばネマティック液晶やスメクティック液晶、コレステリック液晶、ディスコティック液晶等であるが、電界を加えたときに、液晶分子が回転する液晶であれば、特に限定はない。

この液晶LCと前記一対の壁面B，Bとの間には、一対の配向膜F，Fがそれぞれ
5 設けられている。この一対の配向膜F，Fは、その素材が、例えばポリイミド等の高分子物質である。

この一対の配向膜F，Fは、その対向する面がいずれもラビングされている。そして、そのラビング方向は、いずれも右から左である。

このため、液晶LCのうち、一対の配向膜F，Fと接触する液晶分子mは、一対の
10 配向膜F，Fにアンカリングされる。

すると、下方の壁面Bに設けられた配向膜Fと接触する液晶分子mは、その軸方向を左右方向、つまりラビングした方向に向けて配列する。しかも、液晶分子mは、左端部が配向膜Fから上傾するように配列する、つまりラビングしたときの下流側の端部が配向膜Fから離れるように配列（以下、単にチルトという）される。

15 一方、液晶LCの液晶分子mのうち、上方の壁面Bに設けられた配向膜Fと接触する液晶分子mは、その軸方向を左右方向、つまりラビングした方向に向けて配列し、しかも、左端部が配向膜Fから下傾するように配向する、つまりラビングしたときの下流側の端部がチルトする。

また、下方の配向膜Fと接触する液晶分子mと、上方の配向膜Fと接触する液晶分子mとの間に位置する液晶分子mは、隣接する液晶分子m間の配向の変化がもっとも小さくなるように配列するのである。

したがって、流路Lの一対の壁面B，B間に入れられた液晶LCは、一対の壁面B，B間において、壁面Bに対して垂直な軸周りに 180° ねじれた状態で配列する、つまり、液晶LCは一対の壁面B，B間で 180° ツイストされるのである。

25 なお、液晶LCと前記一対の壁面B，Bとの間に配向膜Fを設けなくてもよく、流路Lの一対の壁面B，Bにラビングレス処理をしてやればよい。

流路Lの内部において、前記一対の壁面B，Bと前記一対の配向膜F，Fとの間には、それぞれ一対の電極E，Eが設けられている。この一対の電極E，Eは、両者を結ぶ線が一対の壁面B，Bと垂直になるように配設されている。また、

この一対の電極E、Eは、電源を有する制御装置Dに接続されている。

- このため、制御装置Dによって一対の電極E、Eに電圧を加えれば、一対の壁面B、B間に、一対の壁面B、Bと垂直な電界e fを形成することができる。この一対の電極E、Eが、特許請求の範囲にいう配向装置であり、一対の電極E、
- 5 Eおよび制御装置Dが液晶分子回転手段C Bを構成している。

なお、一対の電極E、Eは、両者を結ぶ線が一対の壁面B、Bと垂直になるように配設しなくてもよく、一対の電極E、Eに形成される電界e fによって液晶LCの液晶分子mをいずれか一方の壁面Bと交わる面内で回転するように配設すればよい。

- 10 なお、一対の電極E、Eを前記流路Lの外面上に取り付けてもよい。この場合、流路Lの素材を導電体や電界が透過できる素材とすれば、一対の壁面B、B間に電界e fを形成することができる。

- さらになお、流路Lの素材を導電体とした場合、制御装置Dを直接流路Lに接続すれば、制御装置Dによって流路Lに電圧を加えれば、一対の壁面B、B間に
- 15 電界e fを発生させることができる。

つぎに、本実施形態の液晶流動形成機構の作用と効果を説明する。

- まず、制御装置Dによって一対の電極E、E間に電圧を加えると、流路L内の一対の壁面B、B間に、一対の壁面B、Bと垂直な方向の電界e fが発生する。すると、液晶LCの液晶分子mは、その軸方向が電界e fと平行になるように回
- 20 転する(図1(B))。すると、液晶分子mの回転によって、その周囲に速度勾配が発生する。

- このとき、上方の壁面B近傍の液晶分子mおよび下方の壁面B近傍の液晶分子mの軸方向は、いずれも左側端部がチルトしており、しかも両者の間の液晶分子mが一対の壁面B、B間で180°ツイストしているので、ラビング方向に対し
- 25 て垂直な方向から見ると、液晶分子mは上下反対称に配置する。

このため、一対の壁面B、B間において、その中間よりも上方の液晶分子mは反時計回りに回転し、その中間よりも下方の液晶分子mは時計回りに回転するので、上方の壁B近傍の液晶分子mが形成する速度勾配と、下方の壁B近傍の液晶分子mが形成する速度勾配は上下対称となる。

しかも、一対の壁面B，B間の中間における液晶分子mの軸方向は、図1では紙面に対して垂直な面と平行な方向に向いている。つまり、ラビング方向に対して水平面内で90°回転しているから、この液晶分子mが回転してもラビング方向（図1では左右方向）の速度成分は発生しない。したがって、流路L内には、図
 5 1 (C) に示すような速度分布が形成され、右向き、つまりラビング方向と逆向きの液晶流動が発生する。

ついで、一対の電極E，E間への電圧の印加をやめると、液晶分子mは、電圧を加える前の状態に戻る。このとき、一対の壁面B，B間において、その中間よりも上方の液晶分子mは時計回りに回転し、その中間よりも下方の液晶分子mは反時計回りに回転する。つまり、いずれの液晶分子mも一対の電極E，E間への電圧の印加したときと逆方向に回転する。したがって、流路L内には、図1 (C) に示した速度分布とy軸に対して逆向きの速度分布が形成され、左向き、つまりラビング方向の液晶流動が発生する。

しかし、電圧の印加をやめたときに生じる液晶分子mの回転は、その回転速度
 15 が電圧を印加したときに生じる液晶分子mの回転速度よりも遅い。このため、電圧の印加をやめたときに生じる左方向への液晶流動の流量は、電圧を印加したときに生じる液晶分子mの右方向への液晶流動の流量よりも少なくなる。

したがって、流路L内において 一対の電極E，E間に瞬間的に電圧を印加すると、右方向への液晶流動の流量と左方向への液晶流動の流量の差の分だけ右向き、つまりラビング方向と逆向きの流量が発生するのである。
 20

図2は本発明の液晶流動形成機構の概略説明図であり、(A) はXY断面図であり、(B) はXY断面図において電界を加えたときにおける液晶分子の配列を示した図であり、(C) はXY断面図において電界を加えたときに一対の壁面B間に発生する液晶の速度分布を示した図である。図2 (A) および図2 (B) に示すように、液晶LCを、壁面B近傍の液晶分子mの軸方向から見ると、液晶分子mは上下反対称に配置する。しかも、一対の壁面B，B間の中央部における液晶LCの液晶分子mは、その軸方向が、ラビング方向に対して垂直な面と平行な方向に向いている。このため、ラビング方向に対して垂直な方向には、一対の壁面B，B間の中央部に対して上下反対称な速度分布が形成される。
 25

したがって、流路L内には、図2(C)に示すような速度分布が形成され、ラビング方向と垂直な方向には、液晶流動の流量は0となるのである。

よって、本発明の液晶流動形成機構によれば、流路L内において、液晶LCが
 5 E, E間に瞬間的に電圧を印加すると、ラビング方向と垂直な断面において、ラビング方向と逆向きな流量が0とならない液晶流動を発生させることができる。

したがって、ラビング方向に対して垂直な断面、つまり液晶流動の方向と垂直な断面では、液晶流動によってその断面に働く力を、その断面全体で平均しても0とならないので、この液晶流動を、物体を移動させる装置やセンサ、アクチュエータなどに
 10 容易に利用することができる。

また、液晶分子回転手段CBの制御装置Dによって、一对の電極E, E間にパルス状の電圧を断続して加えれば、電圧が印加されるたびに液晶流動が発生するので、流路L内に断続した液晶LCの流れを発生させることができる。しかも、
 15 一对の電極E, E間に加えるパルス状の電圧の時間間隔、つまり電界を加える時間間隔を変化させれば、液晶流動の流量を変化させることができる。さらに、電界又は磁界を加える時間間隔を短くすれば、液晶流動をより連続的な流れに近づけることができる。

なお、一对の配向膜F, Fにおいて、その対向する面をラビングする方向は、同じ方向にしなくてもよい。例えば、下方の配向膜Fのラビング方向に対して、上方の配向膜Fの配向方向を傾けてもよい。この場合、一对の壁面B, B間において、上方の壁面B近傍の液晶分子mは、その軸方向が下方の壁面B近傍の液晶分子mの軸方向に対して、下方の配向膜Fのラビング方向に対する上方の配向膜Fのラビング方向の傾きの分（以下、単にラビング方向の傾きという）だけ傾くように配設され、一对の壁面B, B間において、液晶LCが、ラビング方向の傾きの分だけねじれる。つまり、
 20 ラビング方向の傾きの分だけ、液晶LCをツイストさせることができる。

すると、下方の配向膜Fのラビング方向と平行な方向（図2ではYZ断面）における速度分布だけでなく、下方の配向膜Fのラビング方向と垂直な方向（図2ではXY断面）における速度分布も上下反対称でなくなる。すると、下方の配向膜Fのラビング方向と垂直な方向における液晶流動の流量も0ではなくなるので、液晶

LCには、下方の配向膜Fのラビング方向に対して傾いた液晶流動を発生させることができる。

そして、この下方の配向膜Fのラビング方向に対して傾いた液晶流動は、その断面における流量が0とならない。したがって、この液晶流動と垂直な断面では、液晶流動によってその断面に働く力を、その断面全体で平均しても0とならないので、この液晶流動を、物体を移動させる装置やセンサ、アクチュエータなどに容易に利用することができる。

しかも、液晶LCのねじれ角によって、下方の配向膜Fのラビング方向と平行な方向の流量、および下方の配向膜Fのラビング方向と垂直な方向の流量を変化させることができる。よって、液晶LCをツイストする角度を調整すれば、所望の方向への液晶LCの流れを発生させることができるのである。

さらになお、液晶LCがねじれる方向を規制するカイラル剤を液晶LCに混合すれば、液晶LCがツイストする角度を自在に変えることができる。例えば、下方の配向膜Fのラビング方向に対して、上方の配向膜Fのラビング方向を時計回りに90°傾けた場合、液晶LCに、そのツイストする方向が時計回りとなるように規制するカイラル剤を混合すれば、一对の壁面B，B間において、液晶LCを時計回りに90°ねじることができる。逆に、液晶LCに、そのツイストする方向が反時計回りとなるように規制するカイラル剤を混合すれば、一对の壁面B，B間において、液晶LCを反時計回りに270°ツイストさせることができる。

さらになお、電界を加えたときに液晶分子mの軸方向が電界の方向と垂直になるような液晶の場合には、流路L内において、液晶分子mの軸方向が一对の壁面B，Bと垂直に対してわずかに傾くように配設すればよい。そして、この液晶を一对の壁面B，B間で180°ねじって入れておけば、液晶に電界を加えたときに、流路L内に、図1(C)のような速度分布が形成することができる。

さらになお、流路Lは、対向する一对の壁面B，Bを有していなくてもよく、例えば円管や、一对の壁面が交わるような断面視三角形の樋状の流路や、単なる平板等でもよい。

流路が円管の場合、液晶LCを流路の壁面と交差する軸周りにツイストしておけば、円管の軸方向に沿った液晶流動を発生させることができる。

また、流路が樋状の場合、液晶LCを流路のいずれか1つの壁面と交差する軸周りにツイストしておけば、その壁面に沿って、所望の方向に液晶流動を発生させることができる。

- さらに、流路が平板の場合には、液晶LCを平板と交差する軸周りにツイストしておけば、平板上に所望の方向の液晶流動を発生させることができるし、たとえツイストしていなくても平板上に液晶流動を発生させることができる。

つぎに、本発明の物体移動機構について説明する。

まず、第一実施形態の物体移動機構を説明する。

- 図5は第一実施形態の物体移動機構の説明図である。同図において、符号Pは
10 一対の部材を示している。この一対の部材P、Pは、互いに平行かつ、いずれの部材Pの対向する壁面も平坦面に形成されている。この一対の部材P、Pのうち、一方の部材P（図5では下方の部材P）は固定されているが、他方の部材P（図5では上方の部材P）は一方の部材Pに対して相対的に移動可能に設けられている。

- 15 この一対の部材P、Pにおいて、上方の部材Pの下面と下方の部材Pの上面との間には、液晶LCが入れられている。この液晶LCは、例えばネマティック液晶やスメクティック液晶、コレステリック液晶、ディスコティック液晶等であるが、電界を加えたときに、液晶分子が回転する液晶であれば、特に限定はない。

- この液晶LCと、上方の部材Pの下面および下方の部材Pの上面との間には、一対
20 の配向膜F、Fがそれぞれ設けられている。この一対の配向膜F、Fは、その素材が、例えばポリイミド等の高分子物質である。

この一対の配向膜F、Fは、その対向する面がいずれもラビングされており、下方の部材Pの上面に設けられた配向膜Fは右から左にラビングされており、上方の部材Pの下面に設けられた配向膜Fは左から右にラビングされている。

- 25 このため、上下一対の部材P、P間において、全ての液晶分子mは、その軸方向を左右方向、つまりラビングした方向に向けて配列し、しかも、左端部が上傾するように配列する。

なお、液晶LCと一対の部材P、Pの対向する壁面との間に配向膜Fを設けなくてもよく、流路Lの一対の部材P、Pの壁面にラビングレス処理をしてやればよい。

前記上下一対の部材P，Pと前記一对の配向膜F，Fとの間には、それぞれ一对の電極E，Eが設けられている。この一对の電極E，Eは、両者を結ぶ線が一对の部材P，Pと垂直になるように配設されている。また、この一对の電極E，

5 Eは、図示しない電源を有する制御装置Dに接続されている。

このため、制御装置Dによって一对の電極E，Eに電圧を加えれば、一对の部材P，P間に、一对の部材P，Pと垂直な電界e fを形成することができる。この一对の電極E，Eおよび図示しない制御装置Dが、特許請求の範囲にいう液晶分子回転手段を構成している。

10 なお、一对の電極E，Eは、両者を結ぶ線が一对の部材P，Pと垂直になるように配設しなくてもよく、一对の電極E，Eに形成される電界e fによって液晶LCの液晶分子mがいずれか一方の部材Pと交わる面内で回転するように配設すればよい。

15 なお、一对の電極E，Eを前記一对の部材P，Pの外面上に取り付けてもよい。この場合、一对の部材P，Pの素材を導電体や電界が透過できる素材とすれば、一对の部材P，P間に電界e fを形成することができる。

さらになお、一对の部材P，Pの素材を導電体とした場合、制御装置Dを直接一对の部材P，Pに接続すれば、制御装置Dによって流路Lに電圧を加えれば、一对の部材P，P間に電界e fを発生させることができる。

20 このため、一对の電極E，Eに電圧を加えて上下一対の部材P，Pに垂直な電界e fに形成すれば、液晶LCには、一对の部材P，Pに平行かつラビング方向と平行な流れが発生する。すると、下方の部材Pは固定されているに対し、上方の部材Pは下方の部材Pに対して相対的に移動可能であるから、液晶LCの流れの方向に下方の部材Pを、ラビング方向に沿って移動させることができる(図5 (

25 B))。

また、一对の配向膜F，Fのラビング方向を変えて、上方の部材Pに設けられた配向膜Fのラビング方向を、下方の部材Pに設けられた配向膜Fのラビング方向に対して交差するように設ければ、上方の部材Pに隣接する液晶分子mの軸方向が、下方の部材Pに隣接する液晶分子mの軸方向に対して傾くように液晶LCが

ねじれる。つまり、一对の部材P，P間で、液晶LCが部材Pと交差する軸周りにツイストされる。

すると、下方の部材Pに設けられた配向膜Fのラビング方向に対して一对の部材P，Pに発生する液晶LCの流動方向を、自由に変えることができるので、
5 下方の部材Pに対して上方の部材Pを、水平面内で所望の方向に移動させることができる。

したがって、第一実施形態の物体移動機構によれば、上方の部材P上に移動させたい物体を載せれば、液晶LCの流動によって、その物体を下方の部材Pに対して、水平面内で所望の方向に移動させることができるのである。

10 また、図示しない制御装置Dによって、一对の電極E，E間にパルス状の電圧を断続して加えれば、下方の部材Pに対して上方の部材Pを、断続て移動させることができる。しかも、一对の電極E，E間に加えるパルス状の電圧の時間間隔、つまり電界を加える時間間隔を変化させれば、上方の部材Pの移動量を変化させることができる。さらに、電界又は磁界を加える時間間隔を短くすれば、上方の部
15 材Pをより連続的に移動させることができる。

なお、対向する一对の部材P，Pは平行でなくてもよく、例えば下方の部材Pの壁面に対して上方の部材Pの壁面が傾斜していてもよい。この場合、上方の部材Pと平行な面に沿って、上方の部材Pを移動させることができる。つまり、下方の部材Pに対して上方の部材Pを3次元的に移動させることができる。

20 さらになお、各部材Pの対向する壁面は平坦面でなくてもよい。例えば一方の部材Pの壁面が平坦面であって他方の部材Pの壁面が凹凸を有する面でもよいし、いずれの部材Pの壁面も凹凸を有する面であってもよい。

つぎに、第二実施形態の物体移動機構を説明する。

図6は第二実施形態の物体移動機構の説明図である。第一実施形態の物体移動
25 機構は一对の部材P，Pの間に液晶LCを入れているが、第二実施形態の物体移動機構では、外側部材Aと、この外側部材A内に配設された内側軸Cとの間に液晶LCを入れたことが特徴である。

図6に示すように、内側軸Cは、外側部材A内に収容されており、その中心軸が外側部材Aの中心軸と同軸になるように配設されている。また、この内側軸C

は、外側部材A内において、その軸周りに回転自在に取り付けられている。

前記内側軸Cと外側部材Aとの間には、液晶LCが入れられており、この液晶LCと、内側軸Cの外表面および外側部材Aの内面との間には、一対の配向膜F、Fがそれぞれ設けられている。外側部材Aの内面に設けられた配向膜Fは、図6(A)では時計回りにラビングされており、内側軸Cの外表面に設けられた配向膜Fは反時計回りにラビングされている。よって、上下一対の部材P、P間において、全ての液晶分子mは、その軸方向を内側軸Cの外表面の接線方向に配列し、しかも、下流側が上傾するように配列する。

なお、図示しないが、外側部材Aおよび内側軸Cには、電圧を加えると、外側部材Aおよび内側軸Cの半径方向に電界が形成されるように設けられている。

このため、外側部材Aを固定した状態で、外側部材Aと内側軸Cの間にその半径方向の電界efを形成すれば、液晶LCには、内側軸Cの接線方向に沿って流れが発生する。すると、内側軸Cは、外側部材Aの中空な空間内において、その軸周りに回転可能であるから、液晶LCの流れの方向に沿って、内側軸Cを反時計回りに回転させることができる。

逆に、内側軸Cを固定した状態で、外側部材Aと内側軸Cの間にその半径方向の電界efを形成すれば、液晶LCには、外側部材Aの内表面の接線方向に沿って流れが発生する。すると、外側部材Aは、内側軸Cの軸周りに回転可能であるから、液晶LCの流れの方向に沿って、外側部材Aを反時計回りに回転させることができる。

また、外側部材Aと内側軸Cの間において、液晶がねじれるように一対の配向膜F、Fをラビングすれば、外側部材Aと内側軸Cの間における液晶LCの流れを内側軸Cの接線方向に対して傾けることができる。つまり、内側軸Cおよび外側部材Aを、内側軸Cの軸周りに回転させるだけでなく、内側軸Cの軸方向へも移動させることができる。

したがって、第二実施形態の物体移動機構によれば、液晶LCの流動によって、内側軸Cおよび外側部材Aを、内側軸Cの軸周りに回転させることができる。

また、図示しない制御装置Dによって、外側部材Aと内側軸Cの間に断続して電界efを加えれば、内側軸Cや外側部材Aに断続して回転力を与えることがで

きる。しかも、電界を加える時間間隔を変化させれば、内側軸Cや外側部材Aの回転数を変化させることができる。さらに、電界又は磁界を加える時間間隔を短くすれば、内側軸Cおよび外側部材Aの任意の時間における回転角速度を一定に近づけることができる。

- 5 さらに、外側部材Aと内側軸Cの間において、液晶がねじれるように一对の配向膜F，Fをラビングすれば、内側軸Cおよび外側部材Aを、内側軸Cの軸周りに回転させるだけでなく、内側軸Cの軸方向へも移動させることができる。

つぎに、第三実施形態の物体移動機構を説明する。

- 10 図7は第三実施形態の物体移動機構の説明図である。同図において、符号Lは外側部材を示している。この外側部材Lは、その内部に、例えば対向する一对の壁面B，Bを有する、断面が方形の中空な空間が形成されている。この外側部材Lの左右両端間は、連結通路CPによって連通されている。

なお、外側部材Lの内部に形成される中空な空間は、対向する一对の壁面B，Bを有しておれば、その断面形状は方形でなくてもよい。

- 15 さらになお、外側部材Lの内部に形成される中空な空間は、対向する一对の壁面B，Bを有していなくてもよく、その断面形状が円形であってもよく、特に限定はない。

- 20 前記外側部材Lの中空な空間の内部において、前記外側部材Lの左右方向の間には、この中空な空間を左右に分割するように内側部材IPが収容されている。この内側部材IPは、その外周面を、外側部材Lの壁面Bに接触させたままで、外側部材Lの壁面Bに沿って左右方向に移動することができるように配設されている。

- 25 また、前記外側部材Lの中空な空間の内部および前記連結通路CP内には、液晶LCが入れられている。この液晶LCは、例えばネマティック液晶やスメクティック液晶、コレステリック液晶、ディスコティック液晶等であるが、電界を加えたときに、液晶分子が回転する液晶であれば、特に限定はない。

この液晶LCと、外側部材Lの対向する一对の壁面B，Bとの間には、一对の配向膜F，Fがそれぞれ設けられている。この一对の配向膜F，Fは、その素材が、例えばポリイミド等の高分子物質である。

この一对の配向膜F，Fのうち、下方の壁面Bに設けられた配向膜Fにおいて、図

7における内側部材 I P より右側の部分は左から右にラビングされており、内側部材 I P より左側の部分は右から左にラビングされている。

一方、一对の配向膜 F , F のうち、上方の壁面 B に設けられた配向膜 F においても、内側部材 I P より右側の部分は左から右にラビングされており、内側部材 I P より
5 左側の部分は左から右にラビングされている。

つまり、一对の配向膜 F , F は、いずれも、内側部材 I P より右側の部分は左から右にラビングされ、内側部材 I P より左側の部分は右から左にラビングされているのである。

このため、液晶 L は、外側部材 L の対向する一对の壁面 B , B 間において 1 8 0
10 ° ツイストされ、しかも全ての液晶分子 m の内側部材 I P から遠い側の一端がチルトするように配列するのである。

なお、液晶 L C と対向する一对の壁面 B , B との間には、配向膜 F を設けなくてもよく、流路 L の一对の壁面 B , B にラビングレス処理をしてやればよい。

さらになお、一对の壁面 B , B 間において、液晶 L C のツイスト角は 1 8 0 °
15 に限られず、内側部材 I P に向かう流れを発生させることができれば、特に限定はない。

前記流路 L の一对の壁面 B , B と前記一对の配向膜 F , F との間において、内側部材 I P の左右両側には、二組の電極 E , E が設けられている。この二組の電極 E , E は、いずれも両者を結ぶ線が一对の壁面 B , B と垂直になるように配設されて
20 いる。また、この二組の電極 E , E は、電源を有する制御装置 D に接続されている。

また、この二組の電極 E , E と制御装置 D との間には、切り換えスイッチ S W が設けられている。この切り換えスイッチ S W は、右側の電極 E , E と制御装置 D を接続する位置と、左側の電極 E , E と制御装置 D を接続する位置と、いずれ
25 の電極にも制御装置 D を接続しない中立位置とを備えている。

このため、切り換えスイッチ S W によって、二組の電極 E , E のうちいずれか一方の電極 E , E と制御装置 D を接続し、制御装置 D によって電圧を加えれば、内側部材 I P の左右いずれか一方の電極 E , E 間に、一对の壁面 B , B と垂直な電界 e f を形成することができる。この二組の電極 E , E 、切り換えスイッチ S W

および制御装置Dが、特許請求の範囲にいう液晶分子回転手段を構成している。

なお、各電極E、Eは、両者を結ぶ線が一对の壁面B、Bと垂直になるように配設しなくてもよく、各電極E、E間に形成される電界efによって液晶LCの液晶分子mがいずれか一对の壁面B、Bと交わる面内で回転するように配設すればよい。

さらになお、電極E、Eを前記流路Lの外面上に取り付けてもよい。この場合、流路Lの素材を導電体や電界が透過できる素材とすれば、電極E、E間に電界efを形成することができる。

このため、切り換えスイッチSWによって、二組の電極E、Eのうち右側の電極E、Eを制御装置Dと接続し、制御装置Dによって電圧を加えれば、内側部材IPより右側の液晶LCには右から左に向かって流れる液晶流動が発生する。つまり、液晶LCによって内側部材IPが左に押される。すると、内側部材IPより左側に入っていた液晶LCは、連結通路CPを通過しての内側部材IPより右側に移動することができるので、内側部材IPは左に移動するのである。

また、切り換えスイッチSWを切り換えて、左側の電極E、Eを制御装置Dと接続し、制御装置Dによって電圧を加えれば、液晶LCによって内側部材IPが右に押され、内側部材IPより右側に入っていた液晶LCは、連結通路CPを通過しての内側部材IPより左側に移動することができるので、内側部材IPは右に移動する。

したがって、切り換えスイッチSWを切り換えて、左右いずれか一方の電極E、E間に電圧を加えれば、内側部材IPを左右に移動させることができるのである。

したがって、第三実施形態の物体移動機構によれば、切り換えスイッチSWを切り換えて、左右いずれか一方の電極E、E間に電圧を加えれば、液晶LCの流動によって、流路Lの壁面Bに沿って、内側部材IPを左右に移動させることができるのである。

とくに、液晶LCの液晶分子mが、内側部材IPに対して面对称となるように配列すれば、内側部材IPを左右から押す力を同じにすることができ、内側部材IPを安定して移動させたり元の位置に復帰させたりすることができるので好適である。

また、制御装置Dによって、一对の電極E、E間にパルス状の電圧を断続して加えれば、内側部材IPを、断続して移動させることができる。しかも、一对の

電極E，E間に加えるパルス状の電圧の時間間隔、つまり電界を加える時間間隔を変化させれば、内側部材I Pの移動量を変化させることができる。さらに、電界又は磁界を加える時間間隔を短くすれば、内側部材I Pをより連続的に移動させることができる。

- 5 さらに、切り換えスイッチSWを、連続的に切り換えて、内側部材I Pの右側左側の電極E，E間に電圧を交互に加えれば、内側部材I Pを左右に振動させることもできる。

- 10 なお、液晶Lは、全ての液晶分子mの内側部材I Pから遠い側の一端がチルトするように配列しているが、液晶Lの全ての液晶分子mが、その内側部材I P側の一端がチルトするように配列してもよい。この場合、二組の電極E，Eのうち右側の電極E，Eを制御装置Dと接続して電圧を加えれば、内側部材I Pより右側の液晶L Cには左から右に向かって流れる液晶流動が発生する。すると、内側部材I Pより右側に入っていた液晶L Cは連結通路C Pを通過しての内側部材I Pより左側に移動するので、内側部材I Pが右に押され、内側部材I Pを右に移動させることができる。
- 15 逆に、左側の電極E，Eを制御装置Dと接続して電圧を加えれば、内側部材I Pより左側に入っていた液晶L Cは連結通路C Pを通過しての内側部材I Pより右側に移動するので、内側部材I Pを右に移動させることができるのである。

上記のごとき構成であるので、本発明の物体移動機構は、以下のように応用することができる。

- 20 第一実施形態の物体移動機構を応用すれば、液晶を利用した搬送装置を作ることができる。そして、このような搬送装置等は、非常にコンパクトに作ることができ、しかも微弱な電力などによって駆動させることができるので、例えばマイクロマシーンに付随する作業機械等に適用可能である。

- 25 また、第二実施形態の物体移動機構を応用すれば、液晶を利用したモータを作ることができるし、自動で軸方向に移動するドリルや、刃のみが軸周りに回転するカッタなども作ることも可能である。そして、このようなモータ等は、非常にコンパクトに作ることができ、しかも微弱な電力などによって駆動させることができるので、例えばマイクロマシーンの駆動装置等に適用可能である。

さらに、第三実施形態の物体移動機構を応用すれば、液晶を作動流体とするア

クチュエータに応用することができる。そして、このようなアクチュエータは、非常にコンパクトに作ることができ、しかも微弱な電力などによって作動させることができるので、例えばマイクロマシーンに付随する作業機械等に適用可能である。

- 5 また、第一～第三実施形態の物体移動機構のいずれの場合でも、微弱な電力によって液晶流動を発生させることができるので、微弱な電流が流れたときに発生する磁界や電界を感知して、作動するセンサなどにも応用可能である。

- 10 次に、上下一対の無限平板間に液晶を挿入した状態において、この液晶に無限平板と垂直に電界を加えた場合に、上下一対の無限平板間に発生する液晶流動を計算した結果を示す。流量は、図 1 および図 2 における X 軸および Z 軸方向の流量を求めた。

今回の数値計算には、連続体理論に基づいて 1968 年に開発された Leslie-Ericksen 理論を用いた。空間の離散化には有限差分法を、時間積分にはルンゲクッタ法を使った、使用した言語はフォートラン、計算機は EWS である。

また、今回は、以下の条件で計算を行った。

15

平行平板間距離：1 mm

分割数 ：1 0 0 分割

時間刻み ：1 0⁻⁷ 秒、

磁場強度 ：次式で定義される Zöcher 数が 4 5

20

$$\text{Zöcher 数} = LH\sqrt{\Delta\chi/K_1}$$

(L は平板間距離, H は磁場強度, $\Delta\chi$ は磁化率の異方性, K_1 は広がりに関するフランク弾性定数)

- 25 ツイスト角 ：0 度～5 4 0 度

液晶 ：*p*-azoxyanisole (PAA)

なお、上下一対の無限平板間において、液晶は、ツイスト角が 1 8 0° の場合、液晶分子が図 1 および図 2 の状態となるようにツイストしている。

図8は、(A) は液晶のツイスト角に対するZ軸方向の流量を示した図であり、(B) は液晶のツイスト角に対するX軸方向の流量を示した図であり、(C) は流動方向のZ軸の正の部分に対する角度を、液晶のツイスト角に対して示した図である。同図(A) に示すように、液晶のツイスト角が 0° から変化すると、Z軸方向には、Z軸の負の方向(図1では右方向)への流量が発生し、ツイスト角が 200° 近傍で最大流量となっている。そして、Z軸方向には、必ず負の流量が発生することが示されている。つまり、今回の条件では、Z軸方向には、Z軸の負の方向(図1では右方向)への流量が発生することが確認できる。

一方、X軸方向では、液晶のツイスト角が 0° から変化すると、まず正の方向(図2では左方向)への流量が発生し、ツイスト角が 90° 近傍で最大流量となる。そして、ツイスト角が 180° で再び流量が0となり、ツイスト角が 180° 以上では、全て負の流量へと転じている。つまり、今回の条件では、ツイスト角をかえることによって、X軸方向には正負いずれの方向への流量も発生させることができることが確認できる。

そして、図8(C) に示すように、液晶がツイストされていない場合、つまりツイスト角が 0° の場合には、X軸方向およびZ軸方向のいずれの方向も液晶の流量は0となり、液晶内には流量が発生しない。しかし、液晶が少しでも反時計回りにツイストされると、X軸方向およびZ軸方向には流量が0とならない液晶流動が発生する。このX軸方向およびZ軸方向の流量を合成した流量、つまり上下一対の無限平板間に発生する液晶流動の方向は、液晶LCのツイスト角の増加にともなって、Z軸の正の部分に対する反時計回りの傾きが直線的に大きくなる。そして、液晶LCのツイスト角が 180° になると、Z軸の正の部分に対する液晶流動の傾きが 180° 、つまりZ軸の負の方向への流れとなり、さらに液晶をツイストしてそのツイスト角が 360° になると、Z軸の正の部分に対する液晶流動の傾きが 270° 、つまりX軸の負の方向への流れとなるのである。つまり、液晶LCをツイスト方向を時計回り、反時計回りで変えれば、Z軸方向から 360° の範囲で液晶流動の方向を変化させることができる。

したがって、上下一対の無限平板間において、液晶LCをツイストする角度を調整すれば、上下一対の無限平板間のX軸Z軸平面と平行な方向では、所望の方向に

液晶流動を発生させることができることが確認できる。

産業上の利用可能性

第1発明によれば、液晶分子回転手段によって流路の壁面と交わる面内で液晶分子を回転させれば、壁面に沿って、流量が0とならない液晶流動を発生させることができる。この液晶流動の方向と垂直な断面では、液晶流動によってその断面に働く力をその断面全体で平均しても0とならないので、この液晶流動を、物体を移動させる装置やセンサ、アクチュエータなどに容易に利用することができる。

第2発明によれば、流路の壁面と交差する軸周りに、液晶がツイストされているので、液晶をツイストする角度を調整すれば、所望の方向への液晶流動を発生させることができる。

第3発明によれば、液晶分子回転手段によって流路の壁面と交わる面内で液晶分子を回転させれば、一对の壁面間に、流量が0とならない液晶流動を発生させることができる。この液晶流動の方向と垂直な断面では、液晶流動によってその断面に働く力をその断面全体で平均しても0とならないので、この液晶流動を、物体を移動させる装置やセンサなどに容易に利用することができる。また、液晶をツイストさせる角度によって液晶流動の方向を変化させることができるので、液晶をツイストする角度を調整すれば、所望の方向への液晶流動を発生させることができる。

第4発明によれば、液晶分子がチルトされているので、液晶分子回転手段によって液晶分子を回転させたときに、常に一定の方向に液晶を回転させることができる。よって、常に一定の方向に液晶流動を発生させることができる。

第5発明によれば、配向装置によって電界又は磁界を加えれば、液晶分子が、その軸方向が電界や磁界の方向に対して液晶固有の角度に配向する。液晶分子は配向するときにその重心周りに回転するので、液晶分子の回転に起因する液晶流動を発生させることができる。

第6発明によれば、配向装置によって断続的に電界又は磁界を加えると、一定の方向に断続的な液晶流動を発生させることができる。また、電界又は磁界を加える時間間隔や、電界又は磁界の大きさを変化させれば、液晶流動の流量を変化させることができる。さらに、電界又は磁界を加える時間間隔を短くすれば、液晶流動をより連続

的な流れに近づけることができる。

第7発明によれば、液晶分子回転手段によって一対の部材と交わる面内で液晶分子を回転させれば、一対の部材の対向する壁面間に、壁面に沿った液晶流動が発生する。すると、一対の部材は、壁面を対向させた状態で互いに移動可能であるので、一方の部材を固定すれば、他方の部材を液晶流動の方向に移動させることができる。また、対向する壁面間において液晶をツイストさせれば、その角度によって、液晶流動の方向を変化させることができるので、液晶をツイストする角度を調整すれば、一方の部材に対して他方の部材を所望の方向に移動させることができる。つまり、液晶の流動を部材の移動に利用することができるので、液晶を利用した搬送装置等に応用することができる。

第8発明によれば、液晶分子回転手段によって内側軸の外面または外側部材の内面のいずれか一方と交わる面内で液晶分子を回転させれば、内側軸の外面と外側部材の内面との間に、内側軸の外面の接線方向に沿った液晶流動が発生する。すると、外側部材の中空な空間内において、内側軸が、その軸周りに回転自在に設けられているので、内側軸を固定すれば、外側部材を内側軸の中心軸周りに回転させることができる。逆に、外側部材を固定すれば、内側軸を、その中心軸周りに回転させることができる。また、内側軸の外面と外側部材の内面との間において液晶をツイストさせれば、液晶流動の方向を内側軸の接線方向に対して傾けることができるので、内側軸および外側部材を、内側軸の中心軸周りに回転させるだけでなく、内側軸の中心軸に沿った方向へも移動させることができる。つまり、液晶の流動を部材の回転に利用することができるので、液晶を利用したモータやドリル等に応用することができる。

第9発明によれば、液晶の液晶分子の内側部材から遠い側の端部が外側部材の内面に対してチルトしているので、液晶分子回転手段によって外側部材の内面と交わる面内で液晶分子を回転させれば、内側部材を挟むいずれの液晶にも、内側部材に向かう流れが発生する。このため、内側部材を挟むいずれかの一方の側の液晶を液晶分子回転手段によって回転させれば、内側部材を外側部材の内面に沿って移動させることができる。つまり、液晶流動を内側部材の移動に変換することができるので、液晶を作動流体とするアクチュエータ等に応用することができる。

第10発明によれば、配向装置によって電界又は磁界を加えれば、液晶分子が、その軸方向が電界や磁界の方向に対して液晶固有の角度に配向する。液晶分子は配向するときにその重心周りに回転するので、液晶分子の回転に起因する液晶流動を発生させることができる。

- 5 第11発明によれば、配向装置によって断続的に電界又は磁界を加えると、一定の方向に断続的な液晶流動を発生させることができる。また、電界又は磁界を加える時間間隔や、電界又は磁界の大きさを変化させれば、液晶流動の流量を変化させることができる。さらに、電界又は磁界を加える時間間隔を短くすれば、液晶流動をより連続的な流れに近づけることができる。

- 10 第12発明によれば、液晶分子回転手段によって流路の壁面と交わる面内で液晶分子を回転させれば、壁面に沿って、流量が0とならない液晶流動を発生させることができる。この液晶流動の方向と垂直な断面では、液晶流動によってその断面に働く力をその断面全体で平均しても0とならないので、この液晶流動を、物体を移動させる装置やセンサ、アクチュエータなどに容易に利用することができる。また、液晶を
- 15 ツイストさせる角度によって、液晶流動の方向を変化させることができるので、液晶をツイストする角度を調整すれば、所望の方向への液晶流動を発生させることができる。

- 第13発明によれば、液晶に対して断続的に電界又は磁界を加えると、一定の方向に断続的な液晶流動を発生させることができる。さらに、電界又は磁界を加える時間間隔や、電界又は磁界の大きさを変化させれば、液晶流動の流量を変化させること
- 20 ができるし、電界又は磁界を加える時間間隔を短くすれば、液晶流動をより連続的な流れに近づけることができる。

請求の範囲

- 1 流路と、該流路の壁面に沿って移動可能に設けられた液晶と、該液晶の液晶分子を、前記流路の壁面と交わる面内で回転させる液晶分子回転手段とからなり、前記液晶の液晶分子が回転したときに発生する液晶流動を利用することを特徴とする液晶流動形成機構。
- 2 前記液晶が、前記流路の壁面と交差する軸周りにツイストされたことを特徴とする請求項 1 記載の液晶流動形成機構。
- 3 前記流路が、対向する一对の壁面を有しており、該流路の一对の壁面間に、前記液晶が入れられており、前記流路の一对の壁面間において、前記液晶がツイストされていることを特徴とする請求項 1 記載の液晶流動形成機構。
- 4 前記液晶分子が、前記流路の壁面に対してチルトしていることを特徴とする請求項 1、2 または 3 記載の液晶流動形成機構。
- 5 前記液晶分子回転手段が、前記液晶に、電界または磁界を加えるための配向装置を備えたことを特徴とする請求項 1、2、3 または 4 記載の液晶流動形成機構。
- 6 前記液晶分子回転手段が、前記液晶に電界または磁界を加えるタイミングおよび前記液晶に加える電界または磁界の大きさを制御する制御装置を備えており、該制御装置が、前記液晶に電界または磁界を断続的に加えることを特徴とする請求項 1、2、3、4 または 5 記載の液晶流動形成機構。
- 7 互いに対向する壁面を有し、前記壁面を対向させた状態で、相対的に移動可能な一对の部材と、該一对の部材の対向する壁面間に、該対向する壁面に沿って移動可能に入れられた液晶と、前記液晶の液晶分子を、前記一对の部材の対向する壁面のうち、一方の壁面と交わる面内で回転させる液晶分子回転手段とからなることを特徴とする物体移動機構。
- 8 中空な空間を有する外側部材と、該外側部材の中空な空間の内部に、前記外側部材に対して回転自在に配設された内側軸と、前記外側部材の内面と、前記内側軸の外表面との間に入れられた液晶と、前記液晶の液晶分子を、前記内側軸の外表面または前記外側部材の内面のいずれか一方と交わる面内で回転させる液晶分子回転手段とからなることを特徴とする物体移動機構。

- 9 中空な空間を有する外側部材と、該外側部材の中空な空間の内部に收容され、前記外側部材の中空な空間を分割する内側部材と、前記外側部材の中空な空間に入れられ、前記外側部材の内面と交差する軸周りにツイストされた液晶と、前記液晶の液晶分子を、前記外側部材の内面と交わる面内で回転させる液晶分子回転手段とからなり、
- 5 前記内側部材が、前記外側部材の内面に沿って移動可能であり、前記液晶の液晶分子における、前記内側部材から遠い側の端部が、前記外側部材の内面に対してチルトしていることを特徴とする物体移動機構。
- 10 前記液晶分子回転手段が、前記液晶に、電界または磁界を加えるための配向装置を備えたことを特徴とする請求項7、8または9記載の物体移動機構。
- 10 11 前記液晶分子回転手段が、前記液晶に電界または磁界を加えるタイミングおよび前記液晶に加える電界または磁界の大きさを制御する制御装置を備えており、該制御装置が、前記液晶に電界または磁界を断続的に加えることを特徴とする請求項7、8、9または10記載の物体移動機構。
- 15 12 液晶を、流路内に、その壁面と交差する軸周りにツイストして配置し、液晶分子回転手段によって、前記液晶の液晶分子を、前記流路の壁面と交わる面内で回転させることを特徴とする液晶流動形成方法。
- 13 前記液晶分子回転手段が、前記液晶に電界または磁界を加えるタイミングおよび前記液晶に加える電界または磁界の大きさを制御する制御装置を備えており、該制御装置によって、前記液晶に電界または磁界を断続的に加えることを特徴とする請求項
- 20 12記載の液晶流動形成方法。

要約書

工業的に利用可能な液晶流動を形成することができる液晶流動形成機構および液晶流動形成方法、および液晶流動を利用した物体移動機構を提供する。

- 5 流路Lと、流路Lの壁面Bに沿って移動可能に設けられた液晶LCと、液晶LCの液晶分子mを、流路Lの壁面Bと交わる面内で回転させる液晶分子回転手段とからなり、液晶LCの液晶分子mが回転したときに発生する液晶流動を利用する。液晶分子回転手段CBによって流路Lの壁面Bと交わる面内で液晶分子mを回転させれば、壁面Bに沿って、流量が0とならない液晶流動を発生させることができるので、この液晶流動を、物体を移動させる装置やセンサ、アクチュエータなどに容易に利用すること
- 10 ができる。

15

20

25